

小型マイクロコンタクトプリンター

MP100

多機能マイクロコンタクトプリンター

小型、多機能

指定圧を保持する長時間プリント対応
自動平行出し、自動コンタクト原点設定機能
高分解能、微速動作可能なZ軸ステージ
プリント状況が見やすいガラス製スタンプホルダ

MP100は次世代の電子デバイス製造方法として注目を集める μ CP(microcontact printing)法の実験・研究支援装置です。コンパクトな本体にコンタクト面の自動平行調整機能、指定圧を保持する長時間コンタクトなど多くの機能を持ち、加圧力、剥離力を管理した精密なプリント制御が可能です。□100mmまでのプリントエリアに対応し、特殊形状の試料、スタンプにも各試料ホルダのカスタム製作で対応します。



【特徴】

- ◆ 最大試料サイズ(プリントエリア)□100mmに対応。
- ◆ モータードライブZ軸ステージ加圧機構(プログラム制御)
最大コンタクト圧20N(\approx 2Kgf)。
- ◆ 引張・圧縮両対応の高精度ロードセル採用。
接触圧、剥離圧リアルタイムセンスによるZ軸制御。
- ◆ Z軸移動分解能 $0.1\mu\text{m}$ 、 $0.1\mu\text{m/s}$ 微速度動作可能。
- ◆ タッチパネル式制御ボックス。
- ◆ 球面摺動式平行調整機構および自動平行出し機能。
- ◆ 自動コンタクト原点設定。パラメータティーチング機能。
- ◆ 指定圧保持・長時間コンタクト機能。
- ◆ 粘着性インクに対応する多段階剥離機能。
- ◆ プリント状況が観察し易いガラス製スタンプホルダ。
- ◆ 本体小型デザイン、制御ボックス分離型。
- ◆ 特殊試料ホルダなど各種カスタマイズ可能。

コンタクト方式	スタンプ(上側)固定基準、試料(下側)移動式コンタクト	動作制御	平行出し動作およびプリント動作(切替)
最大スタンプサイズ	スタンプ基板(ガラス)外形として□5インチ t=3mm以下	ティーチング機能	平行出し/コンタクト原点設定時ティーチング可能
最大試料サイズ	□4インチ t=3mm以下	プリント運転モード	オート/ステップモードおよびマニュアル動作
アライメント顕微鏡	オプション(カメラ顕微鏡、実体顕微鏡など)	スタンプホルダ	着脱式、スタンプ基板取付部ガラス製
Zステージ	0~10mm、ACサーボモーター 分解能 $0.1\mu\text{m}$	ユーティリティ	真空 700mmHg以上
XYステージ	$\pm 5\text{mm}$ 、手動 微粗動ハンドル		電源 AC100V 5A 以下
θ ステージ	$\pm 5^\circ$ 手動 微動ツマミ	寸法/重量	本体部 360(H)×300(W)×320(D)mm、40Kg
コンタクト圧	ロードセル定格20N(\approx 2Kgf)、理論分解能 $\pm 0.006\text{N}$		制御部 330(H)×320(W)×500(D)mm、20Kg

特約店

SANMEI GROUP IDENTITY
sanmei 株式会社 三明

〒424-0825 静岡県静岡市清水区松原町6-16
電話 (0543)53-3271 Fax (0543)52-1648

製造元



株式会社 ナノテック
Nanometric Technology Inc.

〒174-0041 東京都板橋区舟渡3-5-8-201

www.nanotech-inc.co.jp
info@nanotech-inc.co.jp

電話(03)3960-3171 Fax (03)3960-3174